附件4：

**中国科学院半导体研究所工作人员**

**在职创办企业审批表**

**（利用与本人及所在团队从事专业相关的科技成果才能创办企业，其他情况不允许创办企业）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 政治面貌 |  |
| 出生年月 |  | 邮箱 |  |
| 所属部门 |  | 联系电话 |  |
| 职务、职称 |  | 人员聘用类型 | □岗位聘用 □项目聘用 |
| 本人及所在团队的科研方向 |  |
| 本人承担在研项目情况 | 示例：任务来源：xx；项目类别：xx计划；项目名称：xx；执行期：x年x月x日；角色：课题负责人等；留所经费：xx万 |
| 拟利用的科技成果情况 | 科技成果名称： |
| 科技成果类型及数量（专利、软著、集成布图等）： |
| 拟采取的转化方式： （专利许可、转让及合作开发等）转化金额： 万元 |
| 拟创办企业的情况（工商注册为准） | 企业名称：  |
| 注册资本： |
| 经营范围： |
| 本人及团队成员在企业的持股情况（包括间接持股）： |
| 本人郑重承诺：以上信息属实，同时创办企业不会影响在研的科研项目工作进展，不会影响主责主业。申请人签字：　　　 时间： 年 月 日 |
| 所属课题组审批意见 | □同意 □不同意课题组组长签字　 　　　 　 时间： 年 月 日 |
| 所属部门审批意见 | □同意 □不同意实验室主任签字：　 　　　 　 时间： 年 月 日 |
| 科技处审批意见 | 是否正在主持民口项目 □是 □否主持的在研或者已经结题的项目是否存在被上级项目主管部门通报批评处罚等情况 □是 □否填写的承担在研民口项目情况是否属实 □是 □否是否存在其他不适合创办企业的情况 □是 □否部门负责人签字：　 　　 　 时间： 年 月 日 |
| 高技术处审批意见 | 是否正在承担高技术项目 □是 □否承担的高技术任务是否进展顺利 □是 □否填写的承担在研高技术项目情况是否属实 □是 □否是否存在其他不适合创办企业的情况 □是 □否部门负责人签字：　 　　 　 时间： 年 月 日 |
| 成果办审批意见 | 拟采取的转化方式是否符合研究所政策 □是 □否□同意 □不同意部门负责人签字：　 　　 　 时间： 年 月 日 |
| 研究所审批意见 | 是否通过所务会审批 □是 □否主管所领导签字：　 　　 　 时间： 年 月 日 |
|  |

注：需后续提交公司营业执照等相关证明材料。